

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՄՊԵՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Pulsed Laser Deposition system with laser system	Pulsed Laser Deposition system with laser system-	Pulsed Laser Deposition system with laser system	ZHENGZHOU CY SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD	Հիմնական վակուումային համակարգ՝ չափս՝ Ø 300-450 մմ Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Ուղղահայաց գլանաձև կառուցվածք, չափս՝ Ø 120×120-160×160 մմ Վակուումային համակարգի կոնֆիգուրացիա Հիմնական վակուումային խցիկ՝ Մեխանիկական պոմպ, մոլեկուլային պոմպ, փական Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Մեխանիկական պոմպ և մոլեկուլային պոմպ (առաջնային խցիկի հետ համատեղ), փական Առավելագույն ճնշում Հիմնական վակուումային համակարգ՝

$$\leq 1 \cdot 10^{-6} \text{ Պա}$$

(նախապատրաստումից և գազագերծումից հետո) Նմուշի ներմուծման համակարգ՝  $\leq 1 \cdot 10^{-3}$  Պա (նախապատրաստումից և գազագերծումից հետո) Վակուումի վերականգնման համակարգ Հիմնական վակուումային համակարգ՝ Այն կարող է հասնել  $(5-1) \times 10^{-3}$  Պա-ի 10-20 րոպեում (համակարգը կարճ ժամանակով ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը և լցվում է չոր ազոտով, որպեսզի սկսվի վակուումի վերականգնումը) Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Այն կարող է հասնել  $5 \times 10^{-3}$  Պա-ի 20 րոպեում (համակարգը կարճ ժամանակով ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը և լցվում է չոր ազոտով, որպեսզի սկսվի վակուումի վերականգնումը) Թիրախի պտտվող հարթակ՝ Թիրախի առավելագույն չափը մոտ 60 մմ է: Կարելի է միաժամանակ տեղադրվել չորս թիրախային նյութեր, թիրախը կարելի է փոփոխել պտույտի միջոցով, յուրաքանչյուր թիրախ կարող է ինքնուրույն պտտվել,

պտտման արագությունը՝ 5-60 պտ/րոպ. Ենթաշերտի տաքացում Նմուշի չափը՝ Ø40-60 Շարժման ռեժիմ՝ Ենթաշերտը անընդհատ պտտվում է, պտտման արագությունը՝ 5-70 պտ/րոպ. Ջեռուցման ջերմաստիճանը՝ Ենթաշերտի տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը՝  $900^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  (վերահսկվող և կարգավորելի) Գազի շրջապտույտի համակարգ՝ 1-ցիկլի գազի հոսքի կարգավորիչ, 1- ցիկլի փչող փական Լրացուցիչ պարագաներ Լազերային սարք՝ Համատեղելի է կոհերենտ լազերների հետ Լազերային ճառագայթների սկանավորման սարք՝ 2D սկանավորման մեխանիկական հարթակ, կատրում է ազատության երկու աստիճանի սկանավորում: Համակարգչային կառավարման համակարգ՝ Վերահսկողությունը իր մեջ ներառում է թիրախի ընդհանուր փոփոխություն, թիրախի ռոտացիա, նմուշի ռոտացիա, նմուշի ջերմաստիճանի կառավարում, լազերային ճառագայթով սկանավորում և այլն: Չբաղեցրած

տարածք չիմնական միավոր՝ 1600 \*  
 1600-1900 \* 1900 մմ<sup>2</sup>  
 Էլեկտրական խցիկ՝ 600 \* 600-800  
 \* 800 մմ<sup>2</sup> (մեկ) չիմնական  
 լազերային համակարգ՝ AO-  
 S-1064-532 Լազեր Ալիքային  
 ազդանշանի ալիքի երկարություն  
 (նմ)՝ 532-1064 ± 1 Աշխատանքային  
 ռեժիմ՝ Acousto-optics Q - անջատելի  
 Մեկ իմպուլսի էներգիա (մՅ)՝ 1-350  
 (350 մՋ 1 կՀց-ում; 180 մՋ 10 կՀց-  
 ում) Կրկնման տեմպի  
 հաճախություն (ՄՀց)՝ 0,1-100  
 Իմպուլսի տևողություն՝ Սովորաբար  
 7-11 նվրկ < 10 կՀց  
 հաճախությունների դեպքում,  
 կախված է հզորությունից և  
 կրկնելիությունից Միջին հզորություն  
 (մՎտ)՝ Միջին հզորությունը (մՎտ) =  
 մեկ իմպուլսի էներգիա (մՅ)\*  
 կրկնելիության հաճախություն (ՄՀց)  
 Էլեկտրաէներգիայի կայունություն (4  
 ժամ RMS)՝ < 3 %, < 5 %, < 10 %,

Լայնակի ռեժիմ՝ TEM<sub>00</sub> M2  
 գործակից՝ < 1,5 Ճառագայթի  
 տրամագիծը բացվածքում (1/e<sup>2</sup>, մմ)՝  
 -1,3 (ընտրովի); -0,4 Ճառագայթների  
 շեղում, ամբողջ անկյուն (mrad)՝ <  
 1,5 (ընտրովի); < 5,0 Բևեռացման

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>ԻՄՊԵՐՍ ԳՐՈՒՄՆԵՐ ՍՊԸ</p>	<p>в качестве участника в рамках</p>	<p>участника в рамках</p>	<p>участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>գործակից՝ &gt;100 : 1 Հորիզոնական ± 5 աստիճան Տաքացման ժամանակ (րոպե)՝ &lt; 10 Ճառագայթի բարձրությունը տակդիրից (մմ)՝ 15-20 Աշխատանքային ջերմաստիճան (օC)՝ 10-35 Սնման աղբյուր (90-264 Վտ փոփոխական հոսանք)՝ PSU - AOM - DL Ակնկալվող աշխատանքային ժամանակահատված (ժամ)՝ 1</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>
<p>1</p>	<p>Pulsed Laser Deposition system with laser system</p>	<p>Pulsed Laser Deposition system with laser system</p>	<p>Pulsed Laser Deposition system with laser system</p>	<p>ZHENGZHOU CY SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD</p>	<p>1 տարի * «Գնումների մասին» ՀՀ տեխնիկական հատվածի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի</p>
					<p>կառուցվածք, չափս՝ Ø 120×120-160×160 մմ Վակուումային համակարգի կոնֆիգուրացիա Հիմնական վակուումային խցիկ՝ Մեխանիկական պոմպ, մոլեկուլային պոմպ, փական Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Մեխանիկական պոմպ և մոլեկուլային պոմպ (առաջնային խցիկի հետ համատեղ), փական Առավելագույն ճնշում Հիմնական վակուումային համակարգ՝</p>

$$\leq 1 \cdot 10^{-6} \text{ Պա}$$

(նախապատրաստումից և գազագերծումից հետո) Նմուշի ներմուծման համակարգ՝  $\leq 1 \cdot 10^{-3}$  Պա (նախապատրաստումից և գազագերծումից հետո) Վակուումի վերականգնման համակարգ Հիմնական վակուումային համակարգ՝ Այն կարող է հասնել  $(5-1) \times 10^{-3}$  Պա-ի 10-20 րոպեում (համակարգը կարճ ժամանակով ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը և լցվում է չոր ազոտով, որպեսզի սկսվի վակուումի վերականգնումը) Նմուշի ներմուծման համակարգ՝ Այն կարող է հասնել  $5 \times 10^{-3}$  Պա-ի 20 րոպեում (համակարգը կարճ ժամանակով ենթարկվում է մթնոլորտի ազդեցությանը և լցվում է չոր ազոտով, որպեսզի սկսվի վակուումի վերականգնումը) Թիրախի պտտվող հարթակ՝ Թիրախի առավելագույն չափը մոտ 60 մմ է: Կարելի է միաժամանակ տեղադրվել չորս թիրախային նյութեր, թիրախը կարելի է փոփոխել պտույտի միջոցով, յուրաքանչյուր թիրախ կարող է ինքնուրույն պտտվել,

պտտման արագությունը՝ 5-60 պտ/րոպ. Ենթաշերտի տաքացում Նմուշի չափը՝ Ø40-60 Շարժման ռեժիմ՝ Ենթաշերտը անընդհատ պտտվում է, պտտման արագությունը՝ 5-70 պտ/րոպ. Ջեռուցման ջերմաստիճանը՝ Ենթաշերտի տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը՝  $900^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  (վերահսկվող և կարգավորելի) Գազի շրջապտույտի համակարգ՝ 1-ցիկլի գազի հոսքի կարգավորիչ, 1- ցիկլի փչող փական Լրացուցիչ պարագաներ Լազերային սարք՝ Համատեղելի է կոհերենտ լազերների հետ Լազերային ճառագայթների սկանավորման սարք՝ 2D սկանավորման մեխանիկական հարթակ, կատրոմ է ազատության երկու աստիճանի սկանավորում: Համակարգչային կառավարման համակարգ՝ Վերահսկողությունը իր մեջ ներառում է թիրախի ընդհանուր փոփոխություն, թիրախի ռոտացիա, նմուշի ռոտացիա, նմուշի ջերմաստիճանի կառավարում, լազերային ճառագայթով սկանավորում և այլն: Չբաղեցրած

տարածք չիմնական միավոր՝ 1600 \*  
 1600-1900 \* 1900 մմ<sup>2</sup>  
 Էլեկտրական խցիկ՝ 600 \* 600-800  
 \* 800 մմ<sup>2</sup> (մեկ) չիմնական  
 լազերային համակարգ՝ AO-  
 S-1064-532 Լազեր Ալիքային  
 ազդանշանի ալիքի երկարություն  
 (նմ)՝ 532-1064 ± 1 Աշխատանքային  
 ռեժիմ՝ Acousto-optics Q - անջատելի  
 Մեկ իմպուլսի էներգիա (մՅ)՝ 1-350  
 (350 մՋ 1 կՀց-ում; 180 մՋ 10 կՀց-  
 ում) Կրկնման տեմպի  
 հաճախություն (ՄՀց)՝ 0,1-100  
 Իմպուլսի տևողություն՝ Սովորաբար  
 7-11 նվրկ < 10 կՀց  
 հաճախությունների դեպքում,  
 կախված է հզորությունից և  
 կրկնելիությունից Միջին հզորություն  
 (մՎտ)՝ Միջին հզորությունը (մՎտ) =  
 մեկ իմպուլսի էներգիա (մՅ)\*  
 կրկնելիության հաճախություն (ՄՀց)  
 Էլեկտրաէներգիայի կայունություն (4  
 ժամ RMS)՝ < 3 %, < 5 %, < 10 %,

Լայնակի ռեժիմ՝ TEM<sub>00</sub> M2  
 գործակից՝ < 1,5 Ճառագայթի  
 տրամագիծը բացվածքում (1/e<sup>2</sup>, մմ)՝  
 -1,3 (ընտրովի); -0,4 Ճառագայթների  
 շեղում, ամբողջ անկյուն (mrad)՝ <  
 1,5 (ընտրովի); < 5,0 Բևեռացման



				<p>գործակից՝ <math>&gt;100 : 1</math> Հորիզոնական <math>\pm 5</math> աստիճան Տաքացման ժամանակ (րոպե)՝ <math>&lt; 10</math> Ճառագայթի բարձրությունը տակդիրից (մմ)՝ 15-20 Աշխատանքային ջերմաստիճան (օC)՝ 10-35 Սնման աղբյուր (90-264 Վտ փոփոխական հոսանք)՝ PSU - AOM - DL Ակնկալվող աշխատանքային ժամանակահատված (ժամ)՝ 1 0000-50000 Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի * «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:</p>
--	--	--	--	--